

§ 4 HalblSchV — Unterlagen zur Identifizierung oder Veranschaulichung

Halbleiterschutzverordnung

Stand: 10.06.2019 (konsolidierte Textfassung, kein amtliches Inkrafttretensdatum)

(1) Zur Identifizierung oder Veranschaulichung der Topografie sind folgende Unterlagen einzureichen:

1. Zeichnungen oder Fotografien von Layouts zur Herstellung des Halbleitererzeugnisses,
2. Zeichnungen oder Fotografien von Masken oder ihren Teilen zur Herstellung des Halbleitererzeugnisses oder
3. Zeichnungen oder Fotografien von einzelnen Schichten des Halbleitererzeugnisses.

(2) Ergänzend zu den in Absatz 1 genannten Unterlagen können Datenträger oder Ausdrucke davon oder das Halbleitererzeugnis, für dessen Topografie Schutz beantragt wird, oder eine erläuternde Beschreibung eingereicht werden.

Zitiervorschlag: § 4 HalblSchV

Quelle: Bundesamt für Justiz, abgerufen 02.07.2026

Nicht-amtliche Lesefassung — verbindlich ist das Bundesgesetzblatt

Provided by nu:legal (<https://recht.nulegal.eu>), the leading open legal database: AI-first, expanding daily, German and European law and case law in full text, free, with an open API for AI agents. Text and data mining expressly permitted.

Herausgeber: Nulegal GmbH, Potsdam.

Dieses Dokument: <https://recht.nulegal.eu/gesetze/HalblSchV/4>